(3) Type of the procurement : Purchase
(4) Basic requirements of the procurement :
A The system must have a wafer transfer mechanism.
B The system must have a load lock chamber, and wafer transfer between the process chamber and the load lock chamber must be possible under vacuum conditions.
C The load lock chamber must have a wafer cassette, and it must be capable of automatically processing at least 10 wafers continuously.
D The system must be capable of etching wafers of various sizes, ranging from 20 mm square to a diameter of 8 inches.
E The system must support automated transfer using wafer cassettes for 4-inch (JEITA／SEMI), 6-inch (JEITA／SEMI), and 8-inch (notched) wafers.
F The system must be able to use at least chlorine-based, fluorine-based, argon, oxygen, and nitrogen gases for etching.
G The system must be capable of high-throughput and anisotropic etching of hard-to-etch materials such as piezoelectric lithium niobate (LiNbO3 : LN) substrates, lithium tantalate (LiTaO3 : LT) substrates, quartz, and silicon carbide (SiC) substrates. Also, when the pattern size is around 100—500 nm, anisotropic etching with a high aspect ratio must be capable. Reference data must be submitted.
H The plasma used for etching must be generated at low pressure and must be high-density.
I The process pressure during etching must be 1 Pa or lower.
J The bias voltage and plasma density on the wafer should be independently controllable.
K The etching distribution within an 8-inch wafer should be within 5%.
L Process monitoring (endpoint detection of a process) should be possible by emission spectroscopy.
M The etching chamber should have a structure that can be added later.
N The log of various measured values of the equipment during etching must be output in a readable format.
O The process recipe must be output in a readable format.
P The control system should be connected to a LAN, and log files and recipe files should be exportable via LAN.
(5) Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　28 April, 2025
(6) The same as the notice above No.24.

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
令和７年３月26日
国立大学法人京都大学長　湊　　長博
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　26
○第５号
1　調達内容
(1) 品目分類番号　22、31
(2) 導入計画物品及び数量　消化器・気管支ビデオスコープ（リース）　一式
(3) 調達方法　借入
(4) 導入予定時期　令和７年度10月以降
(5) 調達に必要とされる基本的な要求要件
A 消化器内視鏡、気管支内視鏡に関連するスコープで、診断、治療等に対応する最新機能を備えていること。
B 清潔に洗浄・保管できる機器であること。
C 修理・保守・代替品の提供が可能であること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１(2)の物品に関する一般的な参考資料及び同(5)の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
(1) 資料等の提供期限　令和７年５月12日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
(2) 提供先　〒606—8507 京都市左京区聖護院川原町54　京都大学医学部附属病院経理・調達課　契約掛長　田井　睦之　電話075—751—3025
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
(1) 交付期間　令和７年３月26日から令和７年５月12日まで。
(2) 交付場所　上記２(2)に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
(1) 開催日時　令和７年４月10日10時00分
(2) 開催場所　京都大学医学部附属病院外来診療棟５階会議室Ｂ
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
6 Summary
(1) Classification of the products to be procured : 22, 31
(2) Nature and quantity of the products to be rent : Gastrointestinal and Bronchial Video scope (lease) 1 Set
(3) Type of the procurement : Rent
(4) Basic requirements of the procurement :
A Equipments for endoscopic diagnosis and treatment of diseases in digestive system and respiratory system.
B Suitable for sanitary washing and keeping.
C Support endoscopic systems and prepare appropriate substitute if required.
(5) Time limit for the submission of the requested material : 17 : 00　12 May, 2025
(6) Contact point for the notice : Nobuyuki Tai Contract Section, Accounting and Procurement Division, Kyoto University Hospital, 54 Kawahara-cho Shogoin Sakyo-ku Kyoto-shi　606—8507　Japan, TEL　075—751—3025

資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。
令和７年３月26日
国立大学法人岡山大学長　那須　保友
◎調達機関番号　415　◎所在地番号　33
○第７号
1　調達内容
(1) 品目分類番号　22、31
(2) 導入計画物品及び数量　Ｘ線循環器診断システム　一式
(3) 調達方法　購入等
(4) 導入予定時期　令和７年度第３・四半期以降
(5) 調達に必要とされる基本的な要求要件
A 平面検出器装置及びＸ線管装置を搭載したバイプレーン型血管撮影装置であること。
B 回転ＤＳＡの撮影及び３Ｄ構築が行えること。
C フラットパネル検出器・Ｘ線管部分に安全機能を有し、高精細画像が得られること。
D 血管内治療を支援する機能及び解析機能を有すること。
E 患者及び医療従事者に対する被ばく低減機構を有すること。
F 面積線量計が装備されていること。
G 既存の病院情報システム（ＨＩＳ）、放射線情報システム（ＲＩＳ）及び画像ネットワーク（ＰＡＣＳ）と接続が可能であること。
H 線量レポート出力方式がＲＤＳＲに対応していること。
2　資料及びコメントの提供方法　上記１(2)の物品に関する一般的な参考資料及び同(5)の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
(1) 資料等の提供期限　令和７年５月12日17時00分（郵送の場合は必着のこと。）
(2) 提供先　〒700—8558　岡山市北区鹿田町２—５—１　岡山大学病院経営・管理課調達グループ政府調達担当　中本めぐ美　電話086—235—7540
3　説明書の交付　本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
(1) 交付期間　令和７年３月26日から令和７年５月12日まで。
(2) 交付場所　上記２(2)に同じ。
4　説明会の開催　本公表に基づく導入説明会を開催する。
(1) 開催日時　令和７年３月28日11時00分
(2) 開催場所　岡山大学医学部管理棟小会議室
5　その他　この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。